

РЕКОМБИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В 6Н-SiC *p*—*n*-СТРУКТУРАХ И ВЛИЯНИЕ НА НИХ ГЛУБОКИХ ЦЕНТРОВ

Аникин М. М., Зубрилов А. С., Лебедев А. А.,
Стрельчук А. П., Черенков А. Е.

Проведено исследование времени жизни и диффузионных длин неосновных носителей тока в *p*—*n*-структуратах, изготовленных на основе 6Н-SiC по различным технологиям. Методом DLTS исследованы концентрации и параметры имеющихся в этих структурах глубоких уровней (ГУ).

Исходя из статистики Шокли—Рида показано, что два обнаруженных ГУ [$S(E_c=0.35 \text{ эВ})$ и $R(E_c=1.27 \text{ эВ})$] могут определять рекомбинационные процессы в исследовавшихся *p*—*n*-структуратах.

Введение. Рекомбинационные характеристики полупроводниковых материалов определяют параметры большинства приборов. Поэтому исследования имеющихся в данном полупроводнике каналов рекомбинации являются актуальной исследовательской задачей.

Ранее [1–3] было обнаружено, что время жизни дырок в *n*-SiC находится в пределах 10^{-7} — 10^{-9} с, а их диффузионная длина — 0.01 — 1 мкм. Очевидно, что в SiC (как непрямозонном полупроводнике) основная рекомбинация идет с участием глубоких уровней (ГУ). Однако центров, которые могли бы определить столь малое время жизни, к настоящему времени в SiC обнаружено не было.

Таким образом, основная задача настоящей работы — комплексное исследование рекомбинационных характеристик неосновных носителей тока (стационарного и релаксационного времени жизни и диффузионной длины) и параметров ГЦ в 6Н-SiC *p*—*n*-структуратах, выполненных различными методами, на основе синтеза полученных результатов определение влияния обнаруженных ГУ на процессы безызлучательной рекомбинации в исследовавшихся структурах.

1. Образцы

Были исследованы *p*—*n*-структуратаы, *n*-база которых была получена бесконтейнерной жидкостной эпитаксией (БЖЭ структуры) [4] либо сублимационным сэндвич-методом в открытой системе (СЭ структуры) [5]. *p*—*n*-Переход был создан либо эпитаксиальным наращиванием *p*⁺-слоя, легированного в процессе роста алюминием, либо ионной имплантацией алюминия. Концентрация нескомпенсированных доноров в базе N_d^a — N_a^a составляла 10^{16} — 10^{18} см^{-3} . Меза-структуратаы площадью $2 \cdot 10^{-3}$ — $1.6 \cdot 10^{-2} \text{ см}^2$ были сформированы плазмохимическим травлением.

2. Стационарное время жизни неосновных носителей заряда (ННЗ) τ_{st} определялось из стационарных прямых вольт-амперных характеристик (ВАХ) *p*—*n*-структур.

Ранее [6, 7] было показано, что в значительном интервале температур ($T = 300$ — 800 K) прямые ВАХ исследуемых *p*—*n*-структур, как правило, состоят из двух экспоненциальных участков вида $J = J_0 \exp(qU/\beta kT)$; $\beta = \text{const}$ (T). На верхнем участке ВАХ ($J = 10^{-4}$ — $10^0 \text{ A}/\text{см}^2$) были выделены термоинжекционные токи с дробными значениями β . Обнаружено соответствие данных токов

модели рекомбинации носителей заряда в слое объемного заряда (СОЗ) $p-n$ -перехода через многоуровневый центр с одним «глубоким» (вероятность термических выбросов с которого пренебрежимо мала) и одним или несколькими «мелкими» (вероятность выброса близка к вероятности обратного захвата из зоны) уровнями. Параметрами модели являются, в частности, концентрация центра и сечение захвата на глубокий и мелкий уровни [8]. Однако задача выделения стационарного времени жизни, определяемого рекомбинацией через многоуровневый центр, пока не решена. Задача определения τ_{st} может быть

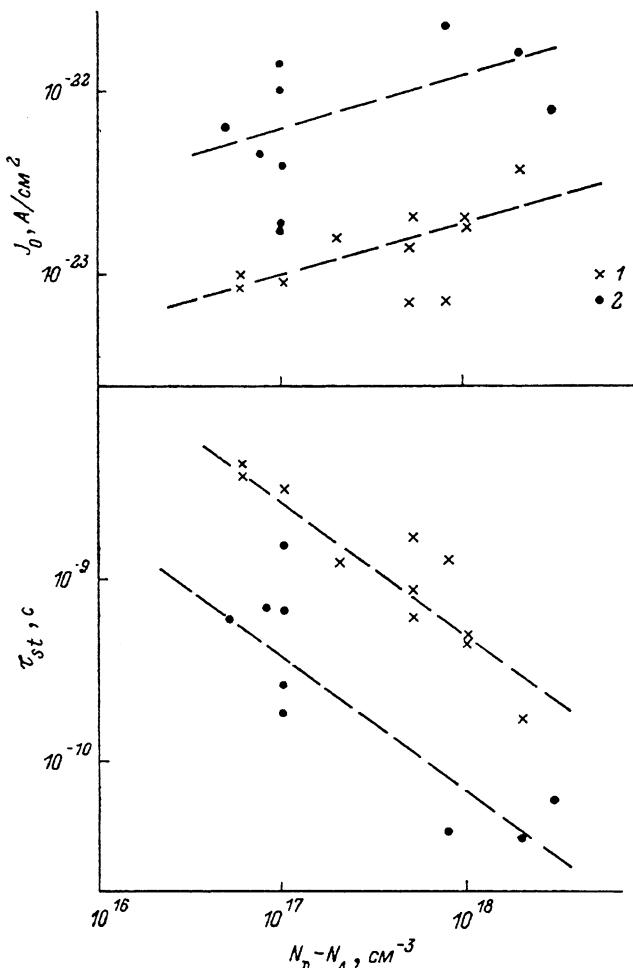


Рис. 1. Зависимости параметров J_0 и τ_{st} от концентрации $N_d - N_a$ в базовой области $p-n$ -структур.

1 — БЖЭ структуры, 2 — СЭ структуры.

решена для нижнего участка прямой ВАХ ($J \leq 10^{-4} \text{ A/cm}^2$), где у части $p-n$ -структур обнаруживается термоинжекционный ток с $\beta = 2$, т. е. ток, удовлетворяющий модели Шокли—Нойса—Саа, рекомбинации в СОЗ $p-n$ -переходы через глубокий уровень вблизи середины запрещенной зоны [9]. Согласно модели, предэкспоненциальный множитель J_0 для такого тока определяется как

$$J_0 = \frac{q n_i^\alpha}{\tau_{st}}, \quad (1)$$

где n_i — собственная концентрация носителей заряда ($n_i = 10^{-6} \text{ см}^{-3}$ при $T = 293 \text{ K}$ [10]), $\alpha = \frac{kT}{qE}$ — эффективная ширина области рекомбинации, E — напряженность электрического поля в $p-n$ -переходе.

На рис. 1 приведены экспериментально полученные при $T = 293$ К величины J_0 и рассчитанные по формуле (1) значения τ_{st} для БЖЭ и СЭ структур.

Отметим в среднем на порядок большие значения J_0 и соответственно на порядок меньшие значения τ_{st} у СЭ структур (по сравнению с БЖЭ структурами) при выполнении условия одинаковой температурной зависимости J_0 , которая определяется шириной запрещенной зоны и температурной зависимостью сечений захвата, это свидетельствует о меньшей на порядок концентрации рекомбинационных центров в БЖЭ структурах. Отметим также, что ГУ вблизи середины запрещенной зоны обнаруживаются и по обратным ВАХ СЭ $p-n$ -структур, которые при повышенных температурах демонстрируют наличие генерационного тока через такой уровень [11].

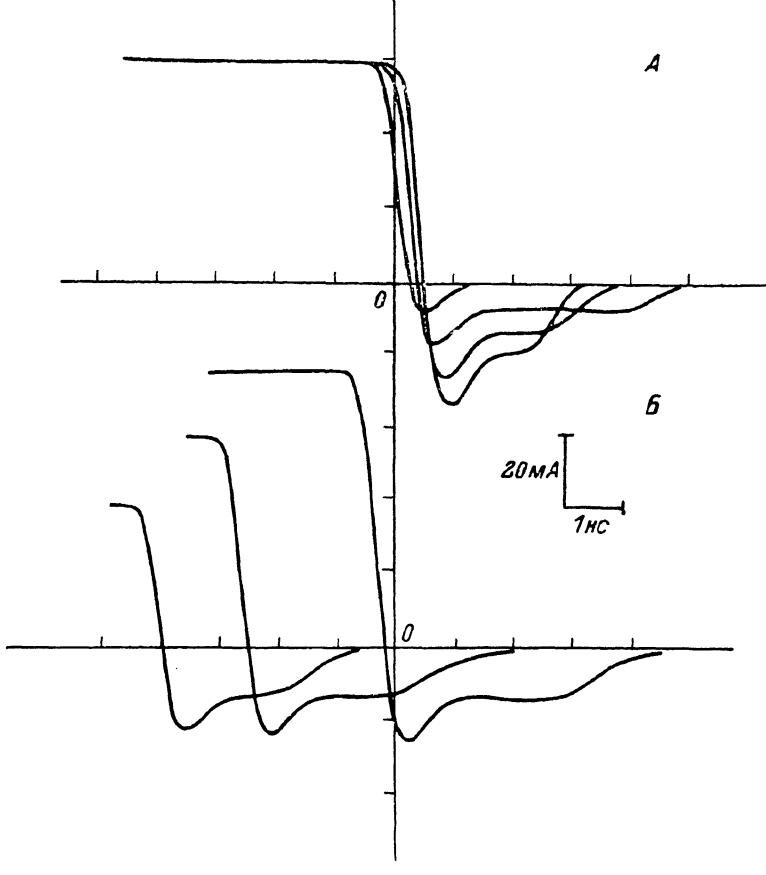


Рис. 2. Переходные характеристики переключения диода.

А — при неизменном прямом токе, Б — при неизменном обратном токе.

3. Релаксационное время жизни ННЗ (τ_{rel}) определялось по переходной характеристике переключения прямого тока на обратный при комнатной температуре. Для этого через $p-n$ -структуре пропускался постоянный прямой ток I , прерываемый импульсами обратного напряжения длительностью 30—100 нс от генератора ТР-0306. Длительность переднего фронта импульса обратного напряжения, определяющая временнб разрешение установки, составляла 0.5 нс. Нагрузочным сопротивлением являлось входное сопротивление осциллографа (50 Ом), включенное последовательно к $p-n$ -структуре.

Наиболее «быстрые» из зарегистрированных (переходные характеристики) при различных соотношениях прямого и обратного токов приведены на рис. 2. Форма импульса обратного тока позволяет выделить две обычные фазы релаксации (фазу сохранения и фазу быстрого спада), подробно изученные при рекомбинации в квазинейтральной области [12]. Кроме того, в [13] экспериментально было показано, что такие же две фазы наблюдаются и при релаксации, обусловленной

ленной рекомбинацией неравновесных носителей в СОЗ [в (GaAl)As $p-n$ -структурах]. Таким образом, проведенные нами эксперименты аналогичны представленным в работе [13]. Длительность фазы сохранения (t_c) в наших экспериментах (так же, как и в [13]) удовлетворительно описывается логарифмической зависимостью от отношения прямых токов I_f к обратным I_r :

$$t_c = \tau_{rel} \ln \left(1 + \frac{I_f}{I_r} \right). \quad (2)$$

Обработка экспериментальных данных по формуле (2) позволила установить, что τ_{rel} в СЭ структурах равно примерно 2 нс (измерения проведены для нескольких $p-n$ -структур на одной подложке). В БЖЭ структурах $\tau_{rel}=20-30$ нс, т. е. соотношение значений τ_{rel} в СЭ и БЖЭ структурах такое же, как и соотношение значений τ_{st} .

4. Диффузионная длина ННЗ

Диффузионная длина в БЖЭ и СЭ $p-n$ -структурах исследовалась в диапазоне температур 300—800 К. Основные результаты получены при измерении зависимости фототока от ширины слоя объемного заряда $p-n$ -перехода при облучении слабопоглощающимся собственным светом (аналогично [3]). При этом определялась сумма диффузионных длин электронов L_n в p -области и дырок L_p в n -области. В ряде случаев при комнатной температуре производилось раздельное определение L_n и L_p при измерении тока, индуцированного электронным зондом.

В [15] показано, что в БЖЭ структурах с $N_d-N_a=6 \cdot 10^{16}-10^{18} \text{ см}^{-3}$ $L_p + L_n \approx 1.5-0.4$ мкм; в СЭ структурах с $N_d-N_a=10^{16}-3 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$ $L_p + L_n \approx 0.4-0.05$ мкм. Для обеих технологий в среднем наблюдается тенденция к уменьшению диффузионной длины с ростом (N_d-N_a). В БЖЭ структурах при комнатной температуре $L_p \sim (3-7) L_n$ в зависимости от концентрации акцепторной примеси Al. В целом диффузионная длина растет с температурой и ее рост в диапазоне температур 350—800 К для СЭ структур и в диапазоне 650—800 К для БЖЭ структур происходит с энергией активации 120 мэВ, а в БЖЭ структурах в диапазоне температур 300—550 К — с энергией активации 50—60 мэВ (соответственно энергии активации времени жизни без учета температурной зависимости подвижности ННЗ составляют 240 и 80—120 мэВ).

Таким образом, исследование рекомбинационных характеристик СЭ и БЖЭ $p-n$ -структур показало, что в обоих типах структур существуют: а) глубокий центр с уровнем вблизи середины запрещенной зоны, отвечающий за рекомбинацию в слое объемного заряда при низком уровне инжеекции, причем в БЖЭ структурах концентрация этого центра приблизительно на порядок меньше, чем в СЭ структурах; б) многоуровневые центры, имеющие как глубокий, так и мелкие уровни и отвечающие за рекомбинацию в СОЗ при более высоких уровнях инжеекции, причем τ_{rel} в БЖЭ структурах при комнатной температуре примерно на порядок больше, чем в СЭ структурах; в) рекомбинация в квазинейтральной области определяется мелкими уровнями обычного или многоуровнего центра.

5. Параметры глубоких уровней

В БЖЭ и СЭ структурах было обнаружено пять типов ГУ, названных нами L -, i -, D -, S - и R -уровнями (рис. 3). Параметры и характерные концентрации этих уровней в обоих типах структур представлены в таблице. Поскольку из DLTS-спектров ГУ можно определить только одно сечение захвата, а для расчета времени жизни, обусловленного этим уровнем, нужно знать оба сечения, то необходимо было провести дополнительные измерения.

Ранее [16] для L -, i - и D -ГУ (уровни в нижней половине запрещенной зоны n -базы) второе сечение (сечение захвата электронов σ_n) определялось нами по зависимости амплитуды DLTS-пика (ΔC) от длительности задержки (t_3)

Тип уровня	Энергетическое положение, эВ	Сечение захвата электронов, см ²	Сечение захвата дырок, см ²	Средняя концентрация, см ⁻³		Расчетное значение τ при T = 300 К, с	
				СЭ	БЖЭ	СЭ	БЖЭ
L	$E_g + 0.24$	10^{-18}	10^{-15}	$(3 \div 5) \cdot 10^{16}$	10^{15}	$5 \cdot 10^{-6}$	10^{-5}
I	$E_g + 0.52$	10^{-21}	10^{-17}	$(1 \div 3) \cdot 10^{16}$	$5 \cdot 10^{13}$	$3 \cdot 10^{-5}$	$3 \cdot 10^{-2}$
D	$E_g + 0.58$	$3 \cdot 10^{-20}$	$5 \cdot 10^{-16}$	$(1 \div 3) \cdot 10^{15}$	$5 \cdot 10^{13}$	$1 \cdot 10^{-5}$	$1 \cdot 10^{-3}$
S	$E_c - 0.35$	$(1 \div 2) \cdot 10^{-15}$	$(1 \div 2) \cdot 10^{-14}$	$(1 \div 3) \cdot 10^{15}$	$(1 \div 4) \cdot 10^{14}$	10^{-9}	$1 \cdot 10^{-8}$
R	$E_c - 1.27$	$3 \cdot 10^{-13}$	$1 \cdot 10^{-15}$	$(1 \div 3) \cdot 10^{15}$	$(1 \div 4) \cdot 10^{14}$	$(1 \div 3) \cdot 10^{-8}$	$(1 \div 3) \cdot 10^{-7}$

между окончанием импульса инжекции и началом импульса обратного напряжения.

Для оценки второго сечения захвата на S- и R-ГУ (сечение захвата дырок σ_p) проводилось измерение амплитуд DLTS-пиков этих уровней при инжекции ды-

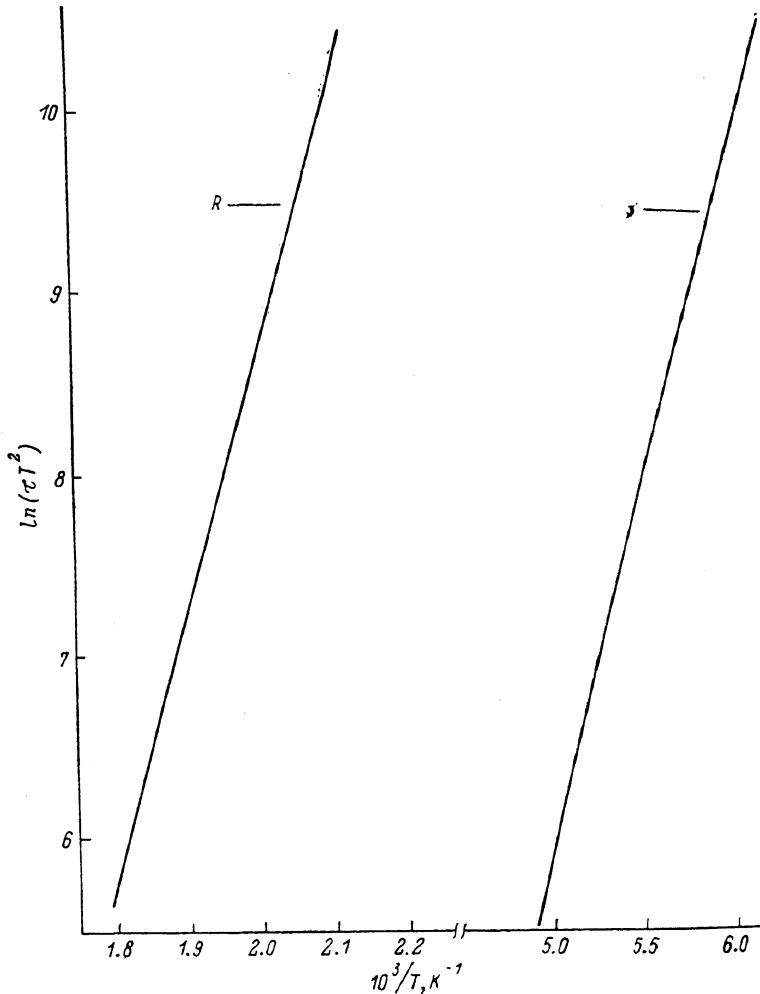


Рис. 3. Зависимости Аррениуса для S- и R-ГУ.

рок и ее отсутствии. Концентрацию заполненных электронами ГУ в верхней половине n-базы (m) можно записать как [14]

$$m = \frac{N_T}{1 + \frac{\sigma_p \Delta p}{\sigma_n (n_0 + \Delta p)}} , \quad (3)$$

где N_T — полная концентрация ГУ, Δp — концентрация инъектированных дырок, n_0 — концентрация электронов в p -базе. Для S -уровня при подаче импульсов инжеクции было обнаружено изменение амплитуды DLTS-пика (ΔC) в 3–5 раз. Для R -ГУ аналогичное изменение ΔC составляло $\sim 1\%$. В соответствии с формулой (3) и величиной σ_n для этих уровней минимальное значение σ , (т. е. при условии $\Delta p > n_0$) можно оценить как $(1 \div 8) \cdot 10^{-15} \text{ см}^2$ (R -уровень) и $1 \cdot 10^{-14}$ (S -уровень). Отметим, что измеренные величины концентраций R и S -ГУ совпали с точностью 10–20 % и в БЖЭ структурах были в среднем на порядок меньше, чем в СЭ структурах. Это дает основание предположить существование одного двухуровневого $R-S$ -центра.

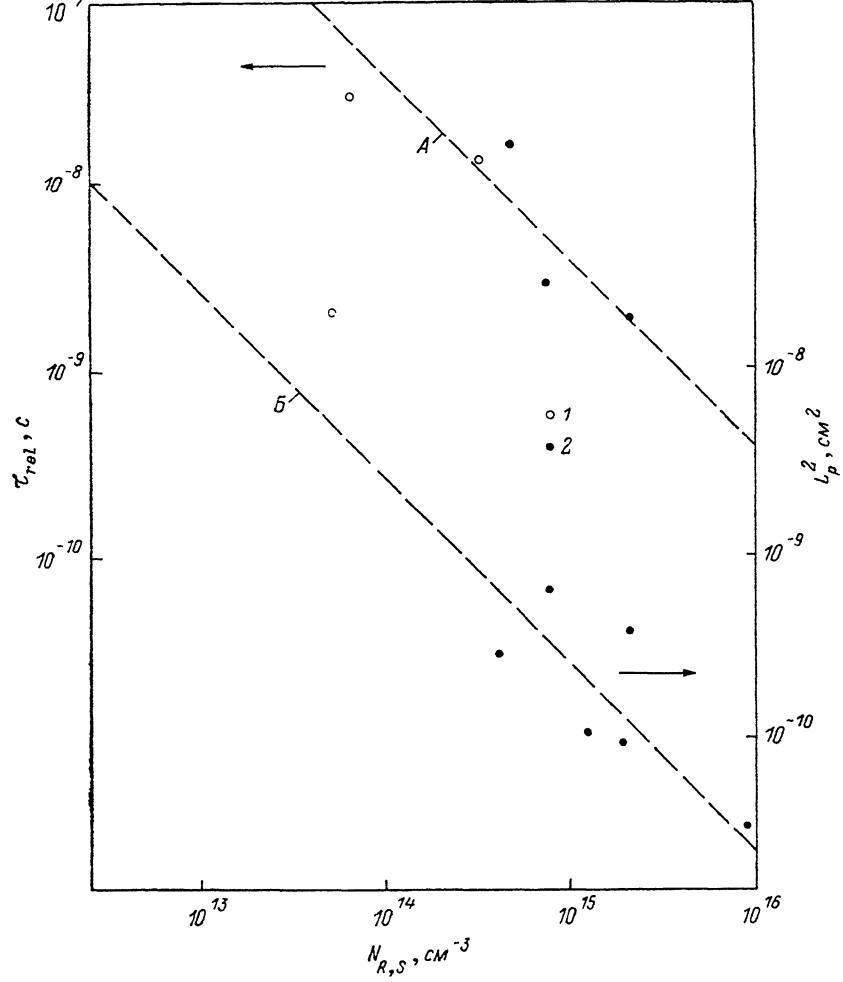


Рис. 4. Зависимость квадрата диффузионной длины ННЗ (A) и их времени жизни (B) от концентрации S - и R -ГУ.

1 — БЖЭ структуры, 2 — СЭ структуры.

Заключение

Исходя из параметров обнаруженных уровней был сделан расчет предполагаемого времени жизни исследовавшихся структур. Известно (см., например, [17]) выражение для времени жизни ННЗ в базовой области $p-n$ -структур

$$\tau = \frac{n_0 + n_1 + \Delta n}{v_T N_T \sigma_p (n_0 + p_0 + \Delta n)} + \frac{p_0 + p_1 + \Delta n}{v_T N_T \sigma_n (p_0 + n_0 + \Delta n)}, \quad (4)$$

где v_T — тепловая скорость носителей, $\sigma_{n(p)}$ — сечение захвата электрона (дырки) на уровень n_1 (p_1) $= N_c (N_s) e^{-E_i/kT}$, E_i — энергия ионизации уровня,

k — постоянная Больцмана, $N_{c(v)}$ — плотность состояний в $c(v)$ -зоне, $p_0(n_0)$ — равновесная концентрация дырок (электронов), Δn — концентрация неравновесных носителей.

Результаты расчета времени жизни по формуле (4) с учетом параметров обнаруженных уровней представлены в таблице. Как видно из таблицы, единственным уровнем, исходя из параметров которого можно объяснить наблюдаемое время жизни, является S -ГУ. Отмеченная ранее большая величина времени жизни ННЗ в БЖЭ структурах по сравнению с СЭ структурами находит объяснение в меньшей концентрации S -ГУ (см. таблицу) в БЖЭ структурах. Исследование зависимости величин τ_{rel} и L_p^2 при комнатной температуре от концентрации S -уровня показало, что эти величины находятся в обратно пропорциональной зависимости (рис. 4).

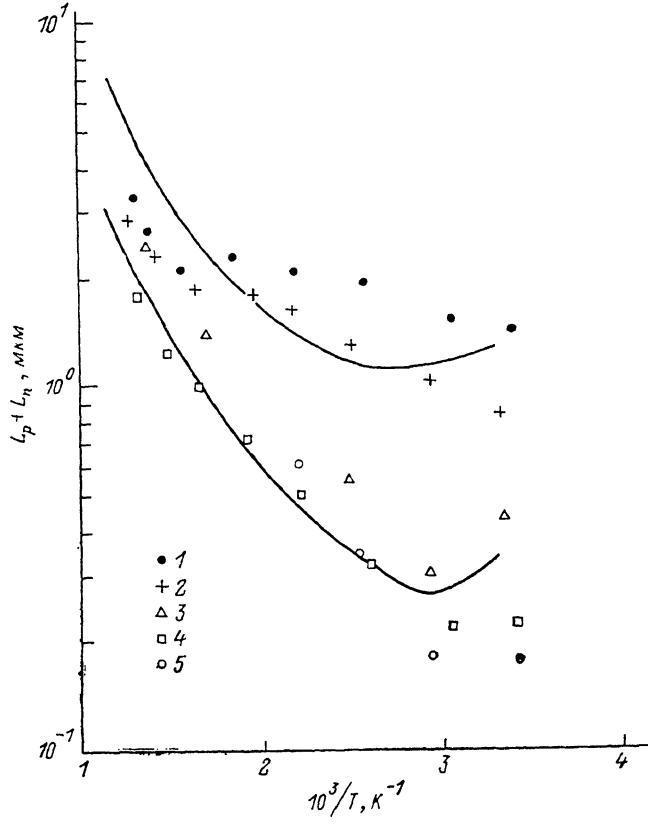


Рис. 5. Зависимость диффузионной длины дырок от температуры в БЖЭ структурах (1, 2) и СЭ структурах (3—5), сплошные линии — расчет при условии $n_0=3 \cdot 10^{18}$ $\Delta n \ll n_0$, $N_c/gT^{3/2} = 2.5 \cdot 10^{16}$ см⁻³.

Измерение времени жизни и диффузионной длины в одних и тех же структурах позволило оценить величину подвижности дырок μ_p^2 . Эта величина составляла 8—10 см²/В·с для СЭ структур и 30 см²/В·с для БЖЭ структур. Полученные величины близки к значениям холловской подвижности μ_p^2 (18—50 см²/В·с) при $T=300$ К, представленным в работе [18]. Исходя из определенной в [18] температурной зависимости подвижности, а также параметров и концентраций S -уровня в БЖЭ и СЭ структурах был сделан теоретический расчет температурного хода L_p и сопоставлен с ранее полученным экспериментально [15] (рис. 5). Расчет зависимости $L_p=f(T)$ исходя из двухуровневой модели (рекомбинационного центра $R-S$ [17]) практически не отличается от представленного на рис. 5 в рассмотренном диапазоне температур ($T \leq 900$ К). Как видно из рисунка, наблюдается хорошее совпадение экспериментальных и теоретических кривых для СЭ диодов. Для БЖЭ структур увеличение энергии

активации ($E_{акт}$) в области высоких температур и приближение ее к значению $E_{акт}$ в СЭ структурах, а также наличие R - и S -ГУ в обоих типах образцов позволяют предположить, что эти ГУ оказывают влияние на рекомбинационные процессы и в БЖЭ структурах при высоких температурах.

Температурный ход L_p в БЖЭ структурах в области низких температур, очевидно, определяется другими причинами, например наличием мелкого рекомбинационного центра с $E_i \sim 0.1$ эВ. Такую энергию ионизации в 6Н-SiC имеют атомы азота, и, возможно, в БЖЭ структурах при низких температурах рекомбинация идет через донорно-акцепторные пары, включающие в себя этот центр. Могут быть предложены и другие объяснения.

Таким образом, можно сделать следующие заключения.

1. За рекомбинационно-генерационные процессы по механизму Шокли—Нойса—Саа через глубокий уровень вблизи середины запрещенной зоны может быть ответствен R -ГУ.

2. Рекомбинацию в квазинейтральной области СЭ структур во всем исследовавшемся диапазоне температур и в БЖЭ структурах при высоких температурах можно связать с S -ГУ.

3. Совпадение концентраций R - и S -уровней и анализ ВАХ в обоих типах структур позволяют предположить существование одного двухуровневого рекомбинационного центра $R-S$.

В заключение авторы благодарят В. В. Евстропова, Н. И. Кузнецова и А. А. Лебедева за помощь в работе и ценные обсуждения.

Список литературы

- [1] Балланович В. С., Виолина Г. Н. // ФТП. 1981. Т. 15. В. 8. С. 1650—1652.
- [2] Наумов А. В., Санкин В. И. // ФТП. 1989. Т. 23. В. 6. С. 1009—1014.
- [3] Санкин В. И. и др. // ФТП. 1982. Т. 16. В. 7. С. 1325—1327.
- [4] Дмитриев В. А. и др. // Письма ЖТФ. 1985. Т. 11. В. 4. С. 238—241.
- [5] Аникин М. М. и др. // Письма ЖТФ. 1984. Т. 10. В. 17. С. 1053—1056.
- [6] Аникин М. М. и др. // ФТП. 1989. Т. 23. В. 10. С. 1813—1818.
- [7] Аникин М. М., Евстропов В. В., Попов И. В., Растигайев В. П., Стрельчук А. М., Сыркин А. Л. // ФТП. 1989. Т. 23. В. 4. С. 647—651.
- [8] Евстропов В. В., Киселев К. В., Петрович И. Л., Царенков Б. В. // ФТП. 1984. Т. 18. В. 10. С. 1852—1858.
- [9] Sah C. T., Noice R. N., Shockley W. // Proc. IRE. 1957. V. 45. N 9. P. 1228—1243.
- [10] Водаков Ю. А. и др. // Проблемы физики технологии широкозонных полупроводников. Л., 1979. С. 164—184.
- [11] Аникин М. М. и др. // ФТП. 1986. Т. 20. В. 5. С. 844—847.
- [12] Носов Ю. Р. Физические основы работы полупроводникового диода в импульсном режиме. М., 1968. 263 с.
- [13] Евстропов В. В., Петрович И. Л., Царенков Б. В. // ФТП. 1981. Т. 15. В. 12. С. 2347—2351.
- [14] Аникин М. М., Лебедев А. А., Лебедев А. А., Сыркин А. Л., Суворов А. В. // ФТП. 1986. Т. 20. В. 12. С. 2169—2172.
- [15] Anikin M. M., Lebedev A. A., Pyatko S. N., Soloviev V. A., Strelchuk A. M. // Abst. of III Int. Conf. on amorphous and crystalline SiC and other group IV—IV materials. Washington, 1990. P. 6.
- [16] Аникин М. М., Лебедев А. А., Кузнецов Н. И., Сыркин А. Л., Стрельчук А. М. // ФТП. 1990. Т. 24. В. 8. С. 1384—1390.
- [17] Рыжкин С. М. Фотоэлектрические явления в полупроводниках. М., 1963. 494 с.
- [18] Van Daal H. J., Knippelberg W. F., Wasschek J. D. // J. Phys. Chem. Sol. 1963. V. 24. P. 109—127.